



NewSUBARUシンポジウム 2011

-放射光ものづくり新産業技術-

日 程：2011年11月18日(金) 10:00 -17:00 参加費無料
意見交換会 17:00 -18:30 ¥3,000-
会 場：TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター5階Aホール
〒104-0031 東京都中央区京橋2-3-19 TEL:03-6202-6100

極端紫外光リソグラフィーによる 次世代半導体製造

兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 教授
極端紫外光リソグラフィー研究開発センター長
木下 博雄



来賓挨拶



文部科学省 研究振興局 基盤研究課
量子放射線研究推進室長
原 克彦

放射光による分析と産業応用 -グリーンナノデバイスの最先端解析-



東京大学放射光連携機構長・教授
日本放射光学会会長
尾嶋 正治

企業による放射光産業利用をサポート

合同会社シンクロトンアナリシスLLC
職務執行者
鶴井 孝文



タルボ干渉計によるX線医療診断器の開発 -乳がんの高感度診断をめざして-

東京大学新領域創成科学 准教授
JST先端計測分析技術・機器開発事業リーダー
百生 敦



ナノインプリント技術による 量産適用とその課題



兵庫県立大学高度産業科学技術研究所長・教授
ナノインプリント研究開発センター長
松井 真二

ガンマ線ビームが可能にする新しい技術 -数十センチの金属内部の非破壊検査とがん治療-

日本原子力研究開発機構 主任研究員
国立天文台 客員教授
早川 岳人



放射光微細加工による バイオマイクロデバイスの機能創成



兵庫県立大学高度産業科学技術研究所 教授
内海 裕一

問い合わせ先：ニュースバル共用促進室

TEL：0791-58-2543

FAX：0791-58-2504

URL：http://www.lasti.u-hyogo.ac.jp/NS/

E-mail：kyoyo@lasti.u-hyogo.ac.jp

主 催：兵庫県立大学高度産業科学技術研究所、兵庫県立大学産学連携機構

後援／協賛：ひょうご科学技術協会、日本放射光学会、レーザー学会、日本化学会、日本機械学会、日本真空協会、
(予定) 電気学会 光・量子デバイス技術委員会 リソグラフィー極限技術調査専門委員会、応用物理学会ナノインプリント技術研究会・シリコンテクノロジー分科会、21世紀播磨科学技術フォーラム、レーザー技術総合研究所
合同会社シンクロトンアナリシスLLC

